

FACOLTÀ	INGEGNERIA
ANNO ACCADEMICO	2012/13
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Ingegneria Elettronica
INSEGNAMENTO	Microtecnologie
TIPO DI ATTIVITÀ	Caratterizzante
AMBITO DISCIPLINARE	Ingegneria Elettronica
CODICE INSEGNAMENTO	10074
ARTICOLAZIONE IN MODULI	NO
NUMERO MODULI	
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI	Ing-Inf/01
DOCENTE RESPONSABILE	Claudio Arnone Professore Ordinario Università di Palermo
CFU	6
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO STUDIO PERSONALE	90
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ASSISTITE	60
PROPEDEUTICITÀ	Nessuna
ANNO DI CORSO	I
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI	Consultare il sito www.ingegneria.unipa.it
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	Lezioni frontali, Esercitazioni in aula, Esercitazioni in laboratorio
MODALITÀ DI FREQUENZA	Obbligatoria
METODI DI VALUTAZIONE	Prova scritta e colloquio orale o presentazione
TIPO DI VALUTAZIONE	Voto in trentesimi
PERIODO DELLE LEZIONI	Secondo semestre
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	Consultare il sito www.ingegneria.unipa.it
ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI	Dopo ogni lezione, per un'ora, o su appuntamento via e-mail.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e capacità di comprensione

Il corso porta a conoscenza dello studente i principali processi tecnologici impiegati per la fabbricazione di microdispositivi per applicazioni nei campi più svariati (elettronica, ottica, chimica, meccanica, biologia). Alla fine del corso lo studente, oltre a conoscere i processi di base, è in grado di comprendere i processi più avanzati specifici per ogni tipologia di dispositivo.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Seguendo il corso lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite sia per la comprensione di diversi e nuovi processi, sia per la implementazione di processi di microfabbricazione tradizionali.

Autonomia di giudizio

Nel corso viene data particolare enfasi nello stimolare la capacità di giudizio autonomo dello studente nel valutare strategie tecnologiche, convenienze economiche, qualità ed efficienza associate alle procedure di fabbricazione studiate.

Abilità comunicative

Il corso è tenuto in modo tale da stimolare e migliorare le abilità comunicative dello studente

in relazione agli argomenti specifici affrontati. Per verifica, la prova di esame prevede anche una breve presentazione (preferibilmente in inglese) di un argomento affrontato durante il corso, nella quale lo studente possa mettere in evidenza le abilità comunicative acquisite.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso offre una sintesi delle problematiche legate alle moderne tecniche di fabbricazione di microdispositivi. Trattandosi di tematiche in continua e rapida evoluzione, gli argomenti affrontati riguardano principalmente materiali e tecnologie di base, la cui conoscenza possa permettere allo studente un eventuale futuro approfondimento autonomo.

ORE FRONTALI	LEZIONI FRONTALI
2	Introduzione storica ed evoluzione delle microtecnologie
2	Applicazioni in elettronica, meccanica, ottica, chimica, biologia
2	Introduzione alla tecnologia planare e sua rilevanza
2	Il silicio e i polimeri come "materiale da costruzione"
2	Tecnologia di crescita di monocristalli
2	Difetti reticolari e loro effetti
2	Processi di base: epitassia, ossidazione
2	Processi di base: chemical vapor depositino (CVD)
4	Processi di base: impiantazione ionica, diffusione, annealing
4	Microlitografia
3	Impiego dei principali fotopolimeri per elettronica, fluidica, meccanica
2	Processi di base: plasma-etching e wet-etching
1	Il controllo della microcontaminazione particellare
4	Tecnologie dell'alto vuoto
1	Spettrometro di massa a quadrupolo
3	Processi di base: physical vapor deposition (PVD) e sputtering
2	Misure ottiche su film sottili
1	Misure microgravimetriche (microbilancia a quarzo)
2	Applicazioni: esempio flussi di processo per microelettronica
2	Applicazioni: esempio flusso di processo per micromeccanica (MEMs)
2	Applicazioni: esempio flusso di processo per microfluidica
2	Applicazioni: esempio flusso di processo per microottica
1	Cenni ai sistemi Lab-on-chip
	ESERCITAZIONI
1	Materiali cristallini, policristallini e amorfi
1	Ossidazione e misura <i>in-situ</i> dello strato ossidato
2	Fabbricazione di un maschera fotolitografica
1	Misure di microcontaminazione particellare
2	Tecniche di microscopia e videomicroscopia
3	Fabbricazione di una struttura micromeccanica, o microottica, o microfluidica
TESTI CONSIGLIATI	G.S. May, S.M. Sze, FUNDAMENTALS OF SEMICONDUCTOR FABRICATION, Wiley (2004), ISBN 0-471-45238-6